

# G-20C01

# 設備規格書

版本 2.0

# 5槽槽式清洗蝕刻實驗設備

設備製造商:

華康半導體股份有限公司

客戶端確認代表:	
,	日期:
(客戶端親簽)	
(客戶端公司名稱)	
華康半導體股份有限公司(設備	製造商)確認代表:
	日期:



#### 1. 適用範圍:

此設備規範之所有內容,完全根據客戶和供應商之間的討論做文字叙述,直到收到正式的採購 訂單;兩份規格表(一式兩份)於客戶與供應商各持一份。

如果客戶若沒有向我司進行確認回覆此份設備規格,此份設備規格視同被接受及批准;設備生產驗收測試和生產設計將根據本規範執行。

#### 2. 修訂版:

根據客戶和廠商之間的協議,經雙方討論過後,決議設備規格有必要進行修改,該更新後之規格表應予以修訂或附錄應加入至此設備規格書。

#### 3. 優先級

除非有書面證據,顯示修改后的規範的相互認可,接受的規格表應優先於所有其他文件。如果書面證據或說明文件的最新版本之前,此規格表具有優先權。



# 修改紀錄

版本	日期	序號	修改項目
版本 1.0	2016. 06. 06	1.0	新訂定
版本 1.0	2016. 06. 20	2. 0	加入Load, unload



# <u></u>員 錄

1.	叙述	. 5
2.	標的	. 5
3.	系統	. 5
3-	1. 系統規範	. 5
	3-2. 操作控制系統	
	3-3. 异常事件系統	8
	3-4. 電子控制系統	9
	3-5. 廠務需求	9
4.	文件	10
5.	安全規範要求	10
6.	設備保固	10
7.	設備機構設計圖示	11



# 1. 叙述

摘要

槽式清洗蝕刻設備是依廠商實驗之要求設計。運用手臂進行移載及升降取/置承載盒(花籃); 和化學藥液控制系統。 此設備採用ACI-100兼容晶片承載盒.

#### 2. 標的

項目	叙述
標的	單/多晶片
矽片尺寸	6" (依據使用的承載盒規格)
矽片厚度	厚度: > 160 μm (切片後矽片)

### 3. 系統

# 3-1. 系統規範

最後系統規範必須被廠商及客戶端雙方共同决議後執行。

位置	項目	規格	備注
N/A	設備主體	機架構成設備的基本框架,由不銹鋼方通和扁通焊接而成。 表面用 3~5mm PP 板包裹,防止腐蝕。	封板組成抽風道、接水盆、設備前部 觀察維修門、設備後部維修門。封板 用不小于 10mm 厚 PP 板焊接而成。
N/A	設備前後部	前部的下面的部分是由PP板焊接而成,是固定的,可以拆卸。 上面的部分由透明PVC板組成易打開的觀察窗。	在處理過程中打開觀察窗機械手是 會停止的。 後部配有由透明 PVC 板組成側推拉 門式維修門
N/A	承載盒作動 手臂傳輸系統	自動交替手臂(SS 金屬骨架,貭 包覆)傳輸系統.(側面使用 PVDF 材貭; 勾爪(Pin)使用 PEEK 材 貭)。	自動傳輸手臂 x1支
N/A	承載盒(花籃)上 載區	上載承載盒區,最多 4個承載盒 (400 月矽月)	人工放置承載盒*2, <b>承</b> 載盒移動方 式采用移載+升降手臂取/置方式。
0	進料等待區	于此區等待手臂取料	
1	純水清洗	快排+ 噴淋+ 溢流、補純水(氣 動閥控制)	數量: 1 PP 槽體, 無上蓋



	溫度控制	RT (無溫度控制)	
	純水入槽控制	液位檢知 浮子流量計目視監測入純水流 量	
	氣泡	CDA 氣泡 ,氣動閥驅動	壓力 2~3 Kg/cm2 工藝槽底部裝有鼓泡系統幷且可以 獨立控制
2	酸洗蝕刻 (HF+HNO3+ HCL)	自動補純水、補藥液	數量: 1. PVDF 槽體 & 管路
	溫度控制	~7°C	冷却系統 (Chiller) 配置循環槽內冷 卻溫度.
	純水入槽控制	液位檢知控制純水入槽	
	氣泡	CDA 氣泡,氣動閥驅動	壓力 2~3 Kg/cm2 工藝槽底部裝有鼓泡系統幷且可以 獨立控制
	化學藥液補液系 統 (HF)	流量計控制	數量: 1
	化學藥液補液系統 (HNO3)	流量計控制	數量: 1
	化學藥液補液系 統 (HCL)	流量計控制	數量: 1
	藥液循環	10 ~30 LPM	氣動泵 ( bellow pump) 一般使用~20 LPM 循環流量
	化學藥液排放	液位檢知及氣動閥控制排放	
	槽體上蓋	PP 材貭上蓋,使用氣動閥驅動	數量: 2 (每一槽之邊緣兩側) 工藝時將槽體敷嚴,以避免熱量/蒸 汽揮發
NA	藥液冷卻循環外槽(buffer tank)	配純水、配藥液、內部循環、 冷卻	數量: 1, PVDF 槽體 & 管路 夾管式液位偵測器
NA	Chiller	冷卻藥液冷卻循環外槽之藥液	數量: 1
3	純水清洗	快排+ 噴淋+ 溢流、補純水(氣 動閥控制)	數量: 1 PP 槽體, 無上蓋
		·	·



	溫度控制	RT (無溫度控制)	
	純水入槽控制	液位檢知 浮子流量計目視監測入純水流 量	
	氣泡	CDA 氣泡 ,氣動閥軀動	壓力 2~3 Kg/cm2 工藝槽底部裝有鼓泡系統幷且可以 獨立控制
4	KOH 蝕刻 (KOH)	自動補純水、補藥液、內部循 環	數量: 1, PP 槽 槽體容積 ~ 110 L 在綫式加熱器于循環系統內
	溫度控制	60~75°C	
	純水入槽控制	液位檢知控制純水入槽	
	化學藥液補液系 統 (KOH)	流量計控制	數量: 1
	化學藥液循環	30~60 LPM	一般使用 30~50 LPM 循環流量
	化學要液排放	液位檢知及氣動閥控制排放	
	槽體上蓋	PP 材貭上蓋使用氣動閥驅動	數量: 2 (每一槽之邊緣兩側) 工藝時將槽體敷嚴,以避免熱量/蒸 汽揮發
	氣泡	CDA 氣泡,氣動閥驅動	壓力 2~3 Kg/cm2 工藝槽底部裝有鼓泡系統幷且可以 獨立控制
5	純水清洗	快排+ 噴淋+ 溢流、補純水(氣 動閥控制)	數量: 1 PP 槽體, 無上蓋
	溫度控制	RT (無溫度控制)	
	純水入槽控制	液位檢知 浮子流量計目視監測入純水流 量	
	氣泡	CDA 氣泡,氣動閥軀動	壓力 2~3 Kg/cm2 工藝槽底部裝有鼓泡系統幷且可以 獨立控制
6	承載盒下載區	下載承載盒,最多 4 個承載盒 (400 片矽片)	承載盒移動方式采用移載+升降手臂取/置方式,再由人工取出承載盒。加裝承水盤(無熱水慢提拉及熱風乾燥功能,晶片會滴水)。



# 3-2. 操作控制系統

項目	內容	備注
上載區	對于手動上載系統 1)負載信號是綠色閃爍 2)手動上載承載盒 3)自動檢知承載盒上載狀態 4)承載盒上載位置不佳或錯誤時,蜂鳴器報警。	自動上載系統之遠程介面 和裝載方法可討論
化學藥液配酸 及補液	化學藥液由客戶端 CDS 系統管路連結供應至機臺端。化學藥液供應由流量計控制。	華康提供 HNO3 CDS 系統 *1 (200L) 其他 CDS 系統是由客戶廠 務提供,而不是由華康提供
純水供給	連續純水供應及氣動閥控制。	
下載區	對于手動下載系統  1) 負載信號是綠色閃爍  2) 手動下載承載盒  3) 自動檢知承載盒下載狀態  4) 承載盒下載不正確或錯誤時,蜂鳴器報警。黃色閃爍信號作動表示下載區被承載盒占滿。	自動下載系統之遠程介面 和裝載方法可討論

# 3-3. 异常事件系統

項目	内容	備注
初始化進程 (在非正常關機)	操作員需確認承載盒清空,接下"確認"接鈕,設備將運作完成初始化。	
設備有條件的自動關機	<ol> <li>液體溢出或泄漏到機器底部造成泄漏傳感器檢測報警時,設備將停止承載盒投入,會繼續完成已投入之所有工序。紅色信號和蜂鳴器會作動,直到异常情况得到解决。</li> <li>若手臂傳輸系統的位置异常,所有的制程將被停止。除了槽自動清洗和維護過程。紅色信號和蜂鳴器會承載盒,直到异常情况得到解决。</li> <li>PLC 主機報警後,初始化和恢復過程是必要的。</li> <li>壓下 EMO(緊急關閉)開關。設備將被立即關閉幷停止所有操作。</li> </ol>	
化學品輸送系統 (CDS)失敗	1. 該系統將停止承載盒投入,完成剩餘的過程。 2. 紅色信號和蜂鳴器會作動,直到异常情况得到解 决。	華康提供 HNO3 CDS 系統*1 其他 CDS 系統是由客戶 廠務提供,而不是由華康 提供



DIW 槽和藥液暫 存槽液位异常 液面傳感器檢測异常作動時,系統將停止承載盒進料,完成餘下的過程。紅色信號和蜂鳴器會作動, 直到异常情况得到解决。

### 3-4. 電子控制系統

;	項目	内容		
硬體控制	PLC	Mitsubishi PLC 系列 and IO 模組		
"实规"字型	使用者介面	前端: 10" TFT LCD (控制)		
通訊功能	遠程控制通訊協議支持下,遊	可能(設備留有通訊接口。在國際認證的 通過特定網絡,在非現場或辦公室可實現對 運行狀况、相關數據、時間和錯誤報警等。)		

#### 3-5. 廠務需求

項目	内容				備註	
	電壓	380 V	/AC			
	頻率	60Hz		AT 担了的拉拉及和酸		
電力需求	相數	3 相	/5綫		(N 相不與接地綫相關 結)	
	電力		: 40 KVA : ~25 KVA		WE)	
	壓力	TBD				
抽氣需求	抽風量	4.9 C	CMM x 3 units MM x 4 units :58.3 CMM			
CDA与岫京式	壓力	> 5kg	r/cm <sup>2</sup>	使用無油式設		
CDA 氣體需求	氣量	最高:100 SLM			CDA	
	壓力	> 2kg	r/cm <sup>2</sup>			
純水需求	流量 最高:50 SLM					
	電阻值	> 5 N	ΙΩ			
冷却水需求	流量	~100]	LPM			
	壓力	> 2kg/cm <sup>2</sup>			華康提供 HNO3 CDS 系	
   化學藥液供應需求	流量	~20 S	LM		統*1 (200L) 其他 CDS 系統是由客戶	
10子亲仪 穴心而小	濃度	TBD			廠務提供,而不是由華 康提供	
溫度	室溫					
濕氣	符合實驗室環境					
排放	管路尺寸 詳情請見管路圖					

<sup>\*</sup> 以上廠務資訊目前僅供參考使用!! 於設備安裝前,會另外提供相關較確切的資訊做使用。



# 4. 文件

項目	内容	數量
使用手册	中文/紙本	1
保養手册	中文/紙本	1
	電路圖/紙本	1
圖面	機構圖/紙本	1
	設備水、氣、電等圖面/紙本	1

### 5. 安全規範要求

項目	内容	備注
EMO 按鈕	6個 EMO 按鈕 for <b>EM</b> ergency <b>O</b> ff (設備停止作動).	
安全貼紙	機構安全規範注意	
	電控安全規範注意	
	激光警告標簽	
門互鎖	制程區域設備門聯鎖啟動當操作關閉	

<sup>※</sup> 如果客戶需要額外的安全功能要求,應當于采購訂單發出之前主動提出。

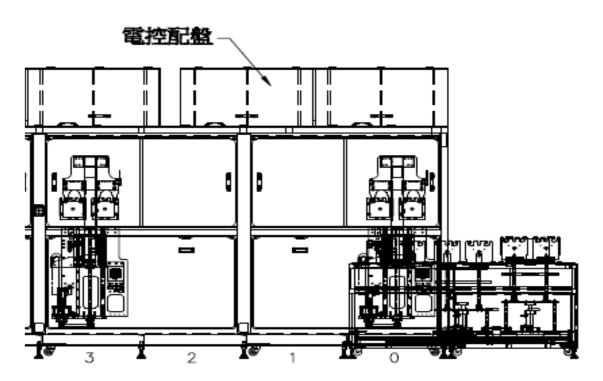
#### 6. 設備保固

保固期起算日:于設備交機至客戶端指定安裝廠區當日算起 14 個月。 下列异常情况的故障不屬[]保固範圍。

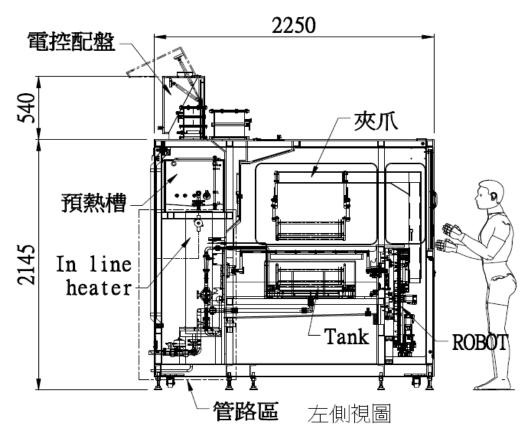
項目	内容	
機構	因粗心的處理和維護導致	
	因未按照使用手册方式使用導致	
	因未按照使用手册方式安裝導致	
	因客戶端自行或請其他廠商修改導致	
	因客戶端提供或推薦之料件修改導致	
	因其他因素, 如地板, 上或下機, 網絡, 效用, 缺陷基板, 載波等導致	
	因天灾導致	
	因耗材導致	
程式	因上述機構情况導致	
	因客戶端自行或請其他廠商修改導致	
	因未按照使用手册方式使用或修改導致	



#### 7. 設備機構設計圖示



圖一. Load 區 正視圖



圖二. 設備 側視圖